

累积式氦检漏仪Pernicka 700H

累积式氦检漏仪(CHLD)结合低温超高真空与质谱仪技术。Pernicka 700H可实现优于传统粗漏和细漏检测方法的密封测试。

该技术可应用于含有一种气体(例如氮气、氦气、氩气、氙气、氙气等)或可用氦轰击的任何密封装置。

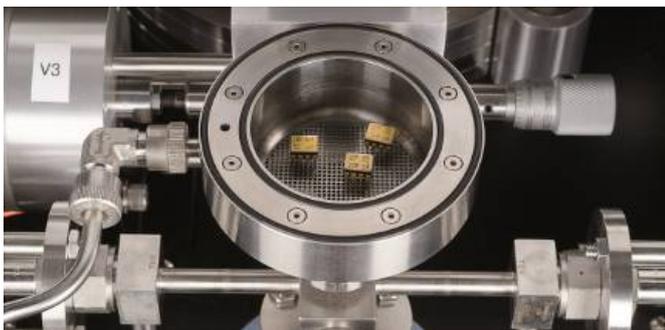


用户优势

- 最小可检漏率 $> 4 \times 10^{-14}$ mbar · l/s, 灵敏度高
- 将细漏和粗漏测试合二为一, 令测试程序快速而高效
- 同时检测碳氟化合物、氮气、氦气、氩气等
- 智能真空设计, 采用坚固耐用的低温泵和涡轮分子泵
- 智能真空设计, 采用坚固耐用的低温泵和涡轮分子泵
- 在高氦抽速下确保高真空度
- 坚固耐用的四极质谱仪可确保长系统运行时间和低维护成本
- 环保 - 运行测试无需使用有毒或有害物质
- 适用于符合以下标准的试漏方法
 - MILStd-750, 方法1071, 程序CH1-CH2
 - MILStd-883, 方法1014, 程序CH1-CH2

典型用途

- 高可靠性电子器件, 例如太空/卫星部件
- 充注有气体的元件
- 大型混合封装电路
- 超小体积器件, 例如SMD封装
- 植入式医疗器械, 例如心脏起搏器、人工耳蜗



CHLD 700H探测器室和测试部件

规范

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 最小可检氦漏率(精检模式) | > 4 x 10 ⁻¹⁴ mbar l/s |
| 最大可检氦漏率(粗检模式) | > 10 ⁻⁴ mbar l/s |
| 可检测质量数 | 2 - 100 |
| 质谱仪 | 四极型 |
| 内置校准测试漏孔漏率范围 | 10 ⁻¹⁰ mbar l/s |
| 测试接口 | DN 16 CF |
| 真空泵系统 | - 涡轮分子泵 - 粗抽泵 - 低温泵 |
| 电源 | 110/120 V, 50/60 Hz, 15 A 220/240 V, 50/60 Hz, 10 A |
| 低温压缩机 (风冷式) | 208至240 V, 50/60 Hz, 10 A |
| 气源 | |
| 阀操作 | 压缩空气, 100 - 110 PSI |
| 冲净气体 | 氩气, 0.5 - 1 PSI |
| 环境条件 | 仅供室内使用 |
| 最大允许海拔高度 (运行期间) | 2000 m |
| 工作温度 | 15至28 °C (60至80° F) |
| 最大相对湿度 | 80% |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 (EN 61010) |
| 重量 | 245 kg (540.13 lb.) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 660 x 1390 x 870 mm (26 x 54.5 x 34.25 in.) |

订购资料

| | 件号 |
|---------------------------------|---------|
| Pernicka 700H | |
| 累积式氦检漏系统 | |
| - 110 V版, 550-700 | 550-700 |
| - 230 V版, 550-701 | 550-701 |
| 选配件: | |
| 双O形圈测试室 | |
| - 大 | 551-710 |
| - 中 | 551-711 |
| - 小 | 551-712 |
| 小型金属密封测试室 | 551-715 |
| 氮气/氩气高纯度净化气体调节器 | |
| 压力设置最大30 PSI | |
| 美国CGA 580气瓶接头 | 551-701 |
| DIN 477 6号气瓶接头 | 551-702 |
| DIN 477 10号气瓶接头 | 551-703 |
| 中国G5/8-14 RH-EXT气瓶接头 | 551-706 |
| 阀操作气体调节器 | |
| 压力设置最大250 PSI | |
| 美国CGA 580气瓶接头 | 551-705 |
| DIN 477 10号气瓶接头 | 551-704 |
| 测试漏孔 | |
| - 空气漏率10 ⁻⁵ mbar l/s | 551-720 |
| - 空气漏率10 ⁻⁶ mbar l/s | 551-721 |